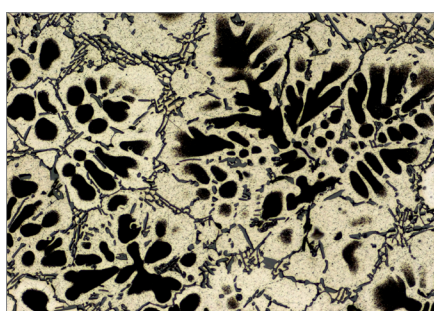


# ZEISS Axio Vert.A1

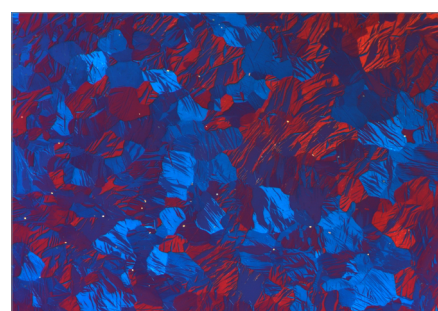
## Your Inverted, All Contrast Microscope for Materials



三眼鏡筒にオプションのカメラを取り付けた例



アルミニウム合金(反射明視野像)  
結晶粒界を認識する事で粒径・位相等の構造解析が可能になります。



純マグネシウム(反射偏光像)  
偏光法では結晶格子の個々の粒子は特徴的な色を表示します。  
ご提供: Allied High Tech Products Inc.

### Highlights

Axio Vert.A1 は、伝統的な手法から高度なコントラスト方法を駆使して、研磨サンプルから大きく重いサンプルを検査する事が出来ます。

反射光での明視野、暗視野、DIC(微分干渉)、C-DIC(ZEISS独自の円偏光微分干渉)、蛍光や偏光などを簡単に切り替えることが出来ます。透過光では、明視野、偏光や位相差コントラストを使用できるようになります。または、サンプルから最大限の情報を引き出すために幾つかのコントラスト方法を組み合わせることも可能です。

エンコード化された5ポジションの対物レンズレボルバは、自動的に対物レンズの切り替えを認識します。PCと接続させる事で対物レンズを切り替える度に設定を変えることなくカメラで撮影して直ぐに画面内計測が可能になります。さらに、それぞれのポジションでの輝度設定の保存が可能なライトマネージャー機能を利用する事で、対物レンズを切り替えても同じ明るさで観察できるようになります。レンズを変える度の輝度調整が不要になるので、思考を止めることなく効率的な検査が可能になります。

- **暗視野対応 5 ポジション対物レンズレボルバ**  
コンパクトな筐体には、エンコード化され低倍から高倍まで最大5本の同時装着が可能です。  
低倍から高倍の切り替えが迅速におこなえます。
- **USB経由でPC接続**  
エンコード化されているので、専用ソフトウェアがレンズを切り替えたことを自動認識します。  
写真撮影時にメモを撮らなくても、撮影条件が自動で保存されます。
- **観察方法を簡単に切り替えられる 4ポジションリフレクターレット**  
反射照明での明視野、暗視野、DIC、C-DICや偏光などのコントラスト方法(観察モード)がワンタッチで切り替えられます。  
同様に、明視野、偏光または位相差の透過光照明をワンタッチで切り替えることも可能です。<sup>\*1)</sup>
- **目視検査用接眼レチクル**  
ASTEM-E 112-88 / ISO 643-1983 などの金属組織解析レチクル「ストラクチャグレイ Ⅰ」をはじめ、方眼レチクル等が使用可能。<sup>\*1)</sup>
- **ZEISSイメージングソフトウェア ZEN2 Core**  
フリーウェアの ZEN2 Core はフォーカス合成(拡張フォーカス)とステッチング(画像連結)機能が利用できます。<sup>\*2)</sup>

### Every Contrast Technique for Your Applications

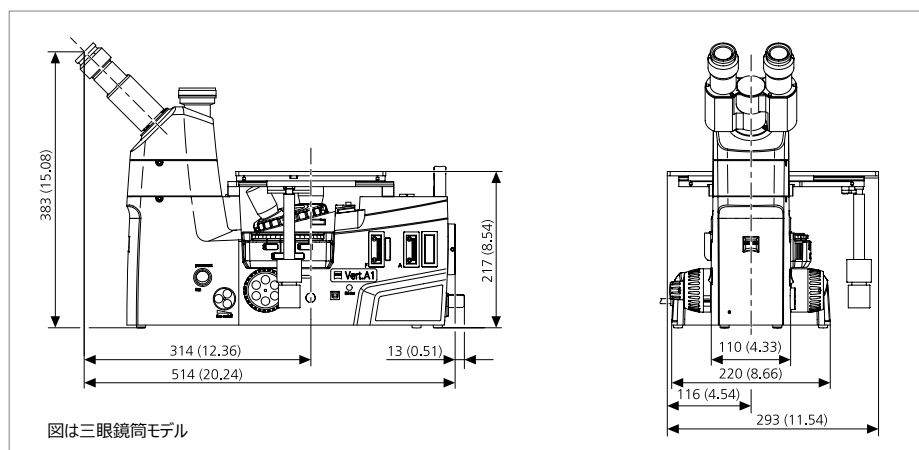
- **エッチングされた表面の微細構造を解析**  
粒界を特定し、粒子サイズ、位相および構造的な解析をおこなえます。
- **不純物やエッチング前の解析**  
鋳鉄中の黒煙などの構造解析に最適です。
- **機械的な表面状態の解析**  
表面欠陥、破損、気孔率や介在物検査など割れ、傷や空洞などの解析に最適です。
- **異方性材料の構造解析**  
偏光では、結晶格子のそれぞれの粒子は特徴的な色を示します。マグネシウム、アルミニウム、青銅や真鍮などの異方性材料の構造分析に最適です。

\*1) オプション \*2) オプションのカメラが必要



# ZEISS Axio Vert.A1

Your Inverted, All Contrast Microscope for Materials



図は三眼鏡筒モデル

### Suitable Applications:

- 構造および構造欠陥の解析
- 断面での層厚みと幾何学的特性の解析
- 反射率の低いサンプルの分析
- 異方性サンプルの解析
- 薄片断面サンプル：  
合成再生品、ポリマー混合物の空間分析  
結晶化度分布、構造差、熱損傷、処理の影響、空洞、介在物および部分結晶性  
高分子材料の内部機械的ストレスの分析
- 特定の位相と鉱物の同定
- アスベスト繊維の解析 等

### Accessories Available:

- 500万画素カラーデジタルカメラ  
AxioCam ERc 5s



価格 ¥308,880(¥286,000)  
0.5x C-マウントアダプタ、アクセサリキットを含む

### テクニカルデータ

本体(鏡基)	マニュアル反射光用倒立顕微鏡 透過光用照明キャリアおよび透過光照明装置(オプション)
対応照明方法	反射光: 明視野
寸法(W x D x H)	220 x 560 x 355 mm (ケーブル等を除く)
重さ	10.3 kg
鏡筒	三眼鏡筒 左, 45°, 23 (50:50), エルゴ中間アダプタ (H=50mm)
接眼レンズ	視野数 23 (W-PI 10x/23 br foc) d= 30 mm
対物レンズレボルバ	5 ポジション H-D, DIC (エンコード機能付き, ねじ径 M27 x 0.75)
対物レンズ	EC Epiplan (5x/0.13, 10x/0.2, 20x/0.4, 50x/0.7)
照明	micro-LED (LED) 出力: 40 W, 電圧: 0 to 12 V DC, LED リスクグループ 1 (DIN EN 62471:2009 準拠), 波長帯: 400 - 650 nm
リフレクターレット	4x リフレクターレット(Push & Click リフレクターモジュール: 明視野)
ステージ	メカニカルステージ 40 x 40 (ステージダイヤフラム d=10, 20, 30 mm)
付属品	ダストカバー

### オプション

照明	Hal 100 (ハロゲン) 光源, VIS-LED (LED) 出力: 20 W
照明方法	反射光: 暗視野, C-DIC, 円偏光, 蛍光, 直線偏光 透過光: 明視野, 偏光, 位相差
リフレクターレット	暗視野, DIC, C-DIC/TIC 他
C-DICスライダ	DIC スライダ CI 6x20
鏡筒	双眼鏡筒, 三眼鏡筒, 双眼エルゴ鏡筒
中間鏡筒	中間カメラ鏡筒, エルゴ中間アダプタ (H=25 mm)
対物レンズ	EC Epiplan 100x/0.90, 他
ステージ	グライディングステージ, スキャニングステージ

価格 **¥1,814,400** (税別¥1,680,000)

### カールツァイスマイクロスコピー株式会社

〒160-0003  
東京都新宿区本塩町7番地

Tel 03-3355-0332  
Fax 03-3359-2118

E-mail microscopy.ja@zeiss.com  
URL <http://www.zeiss.co.jp/microscopy>

大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-35-22  
Tel 06-6337-5465 Fax 06-6337-8017

名古屋営業所 〒465-0043 名古屋市名東区宝が丘 25  
Tel 052-777-1415 Fax 052-777-1417

福岡営業所 〒810-0062 福岡市中央区荒戸 2-1-5  
Tel 092-713-7662 Fax 092-711-0776

仙台営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町 1-12-7  
Tel 022-224-5655 Fax 022-224-5626

●詳しくは、カールツァイスマイクロスコピー各営業所、または弊社機器製品取扱店へお問い合わせください。

### 製品のお問い合わせは

